

(19) 日本国特許庁 (JP)

再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

WO2009/139400

発行日 平成23年9月22日(2011.9.22)

(43) 国際公開日 平成21年11月19日(2009.11.19)

(51) Int.Cl.											
F 1			F 1			F 1			F 1		
<i>HO4R</i>	<i>19/00</i>	<i>(2006.01)</i>	<i>HO4R</i>	<i>19/00</i>	<i>330</i>	<i>A61B</i>	<i>8/00</i>	<i>(2006.01)</i>	<i>A61B</i>	<i>8/00</i>	<i>330</i>
<i>HO4R</i>	<i>31/00</i>	<i>(2006.01)</i>	<i>HO4R</i>	<i>31/00</i>	<i>330</i>						

テーマコード (参考)
4C601
5D019

審查請求 未請求 予備審查請求 未請求 (全 25 頁)

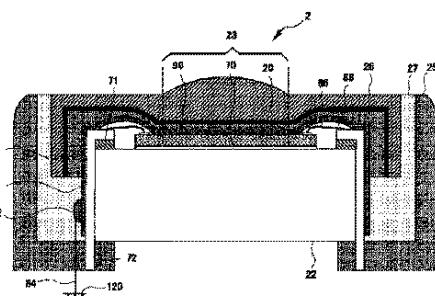
出願番号	特願2010-511995 (P2010-511995)	(71) 出願人	000153498 株式会社日立メディコ
(21) 國際出願番号	PCT/JP2009/058878		東京都千代田区外神田四丁目 14番1号
(22) 國際出願日	平成21年5月13日 (2009. 5. 13)	(72) 発明者	佐野 秀造 東京都千代田区外神田四丁目 14番1号
(31) 優先権主張番号	特願2008-128234 (P2008-128234)		株式会社日立メディコ内
(32) 優先日	平成20年5月15日 (2008. 5. 15)	(72) 発明者	吉村 保廣 茨城県ひたちなか市堀口832番地2 株式会社日立製作所機械研究所内
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)	(72) 発明者	永田 達也 茨城県ひたちなか市堀口832番地2 株式会社日立製作所機械研究所内
		(72) 発明者	深田 慎 東京都千代田区外神田四丁目 14番1号
			株式会社日立メディコ内

(54) 【発明の名称】 超音波探触子及びその製造方法並びに超音波診断装置

(57) 【要約】

本発明の超音波探触子は、バイアス電圧に応じて電気機械結合係数または感度が変化する複数の振動要素を有し超音波を送受波するcMUTチップと、前記cMUTチップの超音波放射側に成膜される導電層と、前記cMUTチップの超音波放射側に配置される音響レンズと、前記音響レンズの超音波放射側の反対方向に成膜される絶縁層と、前記導電層と前記絶縁層が接着剤によって接着された前記cMUTチップ及び前記音響レンズを格納する筐体部と、を備えた超音波探触子であって、前記絶縁層は、シリコン酸化物又はバラキシリレンの少なくとも一方を含み、前記接着剤部分への前記接着剤の溶剤の浸透を防止する材質で形成する。

135



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

バイアス電圧に応じて電気機械結合係数または感度が変化する複数の振動要素を有し超音波を送受波するcMUTチップと、

前記cMUTチップの超音波放射側に成膜される導電層と、

前記cMUTチップの超音波放射側に配置される音響レンズと、

前記音響レンズの超音波放射側の反対方向に成膜される絶縁層と、

前記導電層と前記絶縁層が接着剤によって接着された前記cMUTチップ及び前記音響レンズを格納する筐体部と、

を備えた超音波探触子であって、

10

前記絶縁層は、シリコン酸化物又はパラキシリレンの少なくとも一方を含み、前記接着剤部分への前記接着剤の溶剤の浸透を防止する材質で形成したことを特徴とする超音波探触子。

【請求項 2】

前記絶縁層は、前記音響レンズの内面に沿って形成される請求項1記載の超音波探触子。

【請求項 3】

前記絶縁層が、複数の絶縁膜で構成され、前記複数の絶縁膜のうちの少なくとも一つの絶縁膜が、cMUTチップの超音波放射面に形成され、前記cMUTチップの超音波放射面に形成された残りの絶縁層が、前記音響レンズの内面に沿って形成される請求項1記載の超音波探触子。

20

【請求項 4】

前記cMUTチップの超音波放射側にグランド電位のグランド層が設けられ、前記グランド層はグランド線に接続される請求項1記載の超音波探触子。

【請求項 5】

前記cMUTチップの基板は、cMUTチップの側方から導電樹脂を介してグランド線に接続される請求項4記載の超音波探触子。

【請求項 6】

前記cMUTチップは、前記cMUTチップの電極を超音波放射面または背面まで導通させるスルーホールを具備し、前記cMUTチップの電極は、前記スルーホールを介して前記電気配線部の信号パターンに接続される請求項4記載の超音波探触子。

30

【請求項 7】

前記スルーホールと前記電気配線部の信号パターンとは双方のパッド端子の位置合わせによって接続される請求項6記載の超音波探触子。

【請求項 8】

前記cMUTチップは、前記cMUTチップの基板を超音波放射面または背面まで導通させるスルーホールを具備し、前記cMUTチップの基板は、前記スルーホールを介してグランド線に接続されることを特徴とする請求項4記載の超音波探触子。

【請求項 9】

前記cMUTチップから導電ワイヤを介して電気信号または電力を外部から伝送するフレキシブル基板を備え、

40

前記フレキシブル基板の樹脂材の表面に導電膜が形成されている請求項1記載の超音波探触子。

【請求項 10】

バイアス電圧に応じて電気機械結合係数または感度が変化する複数の振動要素を有し超音波を送受波するcMUTチップと、前記cMUTチップの超音波放射側に設けられる音響レンズと、前記cMUTチップの背面側に設けられ前記超音波の伝播を吸収するバッキング層と、前記cMUTチップの周縁部から前記バッキング層の側面に設けられ前記cMUTチップの電極と接続される信号パターンが配置される電気配線部と、前記cMUTチップ及び前記音響レンズ及び前記バッキング層及び前記電気配線部を格納する筐体部と、を備える超音波探触子の製

50

专利名称(译)	<无法获取翻译>		
公开(公告)号	JPWO2009139400A5	公开(公告)日	2012-05-17
申请号	JP2010511995	申请日	2009-05-13
[标]申请(专利权)人(译)	株式会社日立医药		
申请(专利权)人(译)	株式会社日立メディコ		
[标]发明人	佐野秀造 吉村保廣 永田達也 深田慎 佐光暁史		
发明人	佐野秀造 吉村保廣 永田達也 深田慎 佐光暁史		
IPC分类号	H04R19/00 A61B8/00 H04R31/00		
CPC分类号	B06B1/0292 A61B8/06 A61B8/13 A61B8/4455 G01N29/2406 Y10T29/49005		
FI分类号	H04R19/00.330 A61B8/00 H04R31/00.330		
F-TERM分类号	4C601/EE16 4C601/GA03 4C601/GA08 4C601/GA09 4C601/GB06 4C601/GB16 4C601/GB19 4C601/GB20 4C601/GB32 4C601/GB41 4C601/GB42 5D019/AA26 5D019/DD01 5D019/FF04 5D019/GG03 5D019/GG06 5D019/HH01 5D019/HH02 5D019/HH03		
优先权	2008128234 2008-05-15 JP		
其他公开文献	JPWO2009139400A1 JP5314008B2		

摘要(译)

本发明提供一种超声波探头，其具备：CMUT芯片，其具有根据偏压改变机电耦合系数或灵敏度而发送接收超声波的多个振子元件；形成于CMUT芯片的超声波照射侧的导电层；在CMUT芯片的超声波照射侧配置的声透镜，在与声透镜的超声波照射侧相反的方向上形成的绝缘层，收容CMUT芯片的收纳部，导电层和绝缘层用粘合剂和声透镜固定，其中绝缘层由包括氧化硅或对二甲苯中的至少一种的材料形成，以防止粘合剂的溶剂浸入粘合部分中。